



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu	studia stacjonarne:	M#2-S2-MiBM-301
	studia niestacjonarne:	M#2-N2-MiBM-301
Nazwa przedmiotu	Ochrona patentowa i prawo autorskie	
Nazwa przedmiotu w języku angielskim	Patent and Copyright Protection	
Obowiązuje od roku akademickiego	2024/2025	

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Poziom kształcenia	II stopień
Profil studiów	ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	Studia stacjonarne i niestacjonarne
Zakres	wszystkie
Jednostka prowadząca przedmiot	Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
Koordinator przedmiotu	dr Magdalena Kotulska-Kmieciak
Zatwierdził	dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	Przedmiot kształcenia ogólnego	
Status przedmiotu	obowiązkowy	
Język prowadzenia zajęć	polski	
Usytuowanie w planie studiów - semestr	studia stacjonarne	Semestr III
	studia niestacjonarne	Semestr III
Wymagania wstępne		
Egzamin (TAK/NIE)	NIE	
Liczba punktów ECTS	1	

Forma prowadzenia zajęć		wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	inne
Liczba godzin w semestrze	studia stacjonarne:	15				
	studia niestacjonarne:	9				



Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt „Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-IP.08-0234/23



Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn

**EFEKTY UCZENIA SIĘ**

Kategoria	Symbol efektu	Efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kierunkowych
Wiedza	W01	Ma uporządkowaną wiedzę nt. źródeł i zasad ochrony ochrony autorskoprawnej i patentowej. Potrafi zdefiniować istotne pojęcia i instytucje prawne i dokonać interpretacji norm prawnych z zakresu ochrony autorskoprawnej i patentowej. Umie stosować przepisy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w typowych stanach faktycznych.	MiBM2_W13
Umiejętności	U01	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w językach obcych; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Zna zasady ubiegania się o ochronę wynalazków i wzorów użytkowych, w stopniu pozwalającym mu na kompetentną współpracę z rzecznikiem patentowym. Umie chronić produkty swojej twórczej pracy.	MiBM2_U03 MiBM2_U14 MiBM2_U15
	U02	Potrafi – przy rozwiązywaniu technicznych problemów z zakresu mechaniki i budowy maszyn dostrzegać ich aspekty prawne.	MiBM2_U09 MiBM2_U14 MiBM2_U16
Kompetencje społeczne	K01	Systematycznie, na podstawie dokumentacji patentowej i literatury technicznej śledzi rozwój interesujących go dziedzin techniki. Studiuje opisy patentowe, literaturę prawa własności intelektualnej oraz orzecznictwo sądowe z tego zakresu.	MiBM2_K01
	K02	Potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z cudzych rozwiązań technicznych, utworów i baz danych. Ma świadomość ważności profesjonalnego postępowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.	MiBM2_K02 MiBM2_K05

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć	Treści programowe
wykład	<p>Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym. Modele ochrony dóbr intelektualnych; ochrona autorskoprawna a ochrona patentowa – różnice.</p> <p>Ochrona praw autorskich: treść i zakres praw autorskich; dozwolony użytek chronionych utworów; odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich.</p> <p>Ochrona programów komputerowych; licencje na korzystanie z programów komputerowych i inne umowy autorskoprawne; plagiat.</p> <p>Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym tj. wynalazków i wzorów użytkowych: przesłanki zdolności patentowej i ochronnej; treść patentu i treść prawa ochronnego na wzór użytkowy; ustanie ochrony.</p> <p>Urzędy i organizacje ds. ochrony patentowej; tryb ubiegania się o ochronę formalną w PI i UE; tryb postępowania z wynalazkami tajnymi.</p> <p>Znani wynalazcy i wynalazki w dziedzinie nauk inżynierijno-technicznych.</p>

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ



Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia					
	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Projekt	Sprawozdanie	Inne
W01			X	X		
U01			X	X		
U02			X	X		
K01						X
K02						X

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Forma zajęć	Forma zaliczenia	Warunki zaliczenia
wykład	zaliczenie z oceną	Uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu; przygotowanie i przedstawienie prezencji multimedialnej

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS												
Lp.	Rodzaj aktywności	Obciążenie studenta										Jednostka
		studia stacjonarne					studia niestacjonarne					
		W	C	L	P	S	W	C	L	P	S	
1.	Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów	W	C	L	P	S	W	C	L	P	S	h
		15					9					
2.	Inne (konsultacje, egzamin)	2					2					h
3.	Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	17					11					h
4.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	0,7					0,4					ECTS
5.	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	8					14					h
6.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy	0,3					0,6					ECTS
7.	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym	0					0					h
8.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym	0,0					0,0					ECTS
9.	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	25					25					h
10.	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta</i>	1										ECTS

LITERATURA

- Adamczak A, du Vall M., (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, UOTT UW, Warszawa 2010





Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021
3. Szewc A., (red.), *Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej*, Zakamycze, Kraków 2003
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)
5. Ustawa – prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170).



Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt „Dostosowanie kształcenia w Politechnice
Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki”
nr FERS.01.05-IP.08-0234/23

WMiBM

Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn